

ダイオキシンフリーオーブン(浄化型乾燥器)

KKDシリーズ

ガラス容器等に付着しているダイオキシン・薬品等を完全に気化クリーニングし、気化微粒子を確実に捕集して、測定を高精度化します



KKD-70F II

高温加熱クリーニング

給気系清浄機構～ヒーター上部蛇行加熱管路を通過して高温に加熱されたクリーンエアが供給され、槽内を400～500℃に保持し、ガラス容器や陶器に付着しているダイオキシンや薬品を気化します。気化した微粒子を排気系清浄機構で確実に捕集し、完全にクリーニングして、測定の高精度化及び安全性確保を実現します。

給気系清浄機構

プレフィルター→活性炭フィルター→HEPAフィルターを通した清浄空気が、槽内にポンプで強制給気されます。運転開始時は、一定時間プレクリーニングした後、昇温開始します。

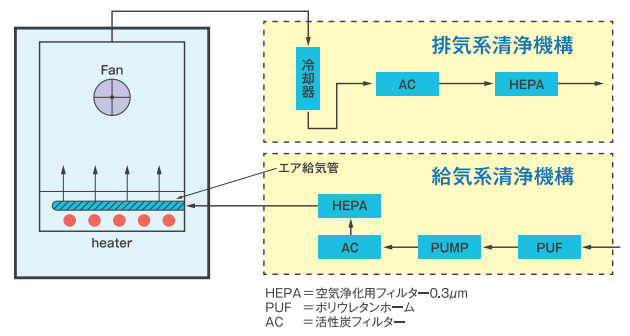
排気系清浄機構

気化したダイオキシン等の微粒子を、高温空気と共に槽外に排気ファンにより強制排出し、水冷式冷却器を通して冷却します。活性炭フィルター及びHEPAからなる排気系清浄機構を通して浄化し、環境に排出しないようになっています。加熱運転終了後槽内が冷え、扉セーフティロックが解除された後も、さらに一定時間はクリーンエアが給気されるようになっています。

扉セーフティロック装置

運転開始と同時にロックされ、運転中は開くことができないようになっています。加熱運転終了後も、クリーン空気が供給され続け、安全上100℃(変更可)まで槽内が冷えた後、扉が開くようになっています。

クリーンエアの流れ



型 式	KKD-70F II
内 寸 法	W725×D540×H630mm
内 容 積	226ℓ
使用温度範囲	100℃～500℃(常用使用温度450℃)
温度調節器	3桁デジタル・PID制御・プログラム付 タイマー:0～99時間59分
温度分布精度	±15℃(at450℃, 中心部 上中下3点, 無負荷時)
給気系清浄機構	プレフィルター + 活性炭フィルター + HEPAフィルター + 給気加圧ポンプ
排気系清浄機構	水冷式冷却器 + 活性炭フィルター + HEPAフィルター + 排気ファン
扉密閉機構	メカニカルシール + 耐熱シリコンパッキン
温度過昇防止装置 (三重)	1. 設定温度+15℃自動設定式 2. 独立温度調節器(700℃固定) 3. 独立液圧式温度調節器(設定温度+30～50℃)
安全装置	扉セーフティロック装置・結露水自動排水 冷却器の出口排気温度及び無給水警報 センサー断線警報・モーター過負荷遮断 過負荷・短絡保護兼用漏電ブレーカー
材 質	内槽:SUS443J1 外板:SUS443J1塗装仕上
ヒ ー タ ー	フィン付ステンレスシースヒーター 2kW×2本
必 要 電 源	AC200V, 単相, 30A以上
外 寸 / 重 量	W1170×D930×H1510mm / 340kg
棚 板	2枚/棚受高さ可変式 耐荷重20kg/枚
価 格 (税 抜 き)	¥1,850,000